IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

EXPRESS MAIL NO. <u>EV327881032US</u>

Applicant

: Marie-Pierre Bacos, et al.

Application No. : N/A

Filed

: March 31, 2004

Title

: PROCESS FOR FORMING A PROTECTIVE COATING CONTAINING

ALUMINIUM AND ZIRCONIUM ON A METAL

Grp./Div.

: N/A

Examiner

: N/A

Docket No.

: 52186/DBP/N75

LETTER FORWARDING CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

PostOffice Box 7068 Pasadena, CA 91109-7068 March 31, 2004

Commissioner:

Enclosed is a certified copy of French patent Application No. 0304104, which was filed on April 2, 2003, the priority of which is claimed in the above-identified application.

Respectfully submitted,

CHRISTIE, PARKER & HALE, LLP

MANGENT D. Bruce Prout Reg. No. 20,958

626/795-9900

DBP/aam

Enclosure: Certified copy of patent application

AAM PAS558335.1-*-03/31/04 11:33 AM

THIS PAGE BLANK (USPTO)

REPUBLIQUE FRANÇAISE



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 25 FEV. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr THIS PAGE DENIES (USPTO)

THIS PAGE BLANK (UL.



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

bis, rue de Saint Pétersbourg		REQUETE EN DELIVRANCE	BR	
5 bis, rue de Saint Petersbourg 1800 Paris Cedex 08 11éphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54		4	page 1/2	
pnone : 33 (1) 33 04	23 04 Telecobie : 20 (x) is a con-		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'enc	re noire DB 540 e W / 2
	IL 2005à l'INPI		NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR	OU DU MANDATAIRE
WISE DES PIECES	ADIO		À QUI LA CORRESPONDANCE DOI	T ÊTRE ADRESSÉE
ATE 75 INPI PARIS			CABINET NETTER	•
	0304104		36 avenue Hoche	
D'ENREGISTREMENT	MANDA		75008 PARIS	_
TIONAL ATTRIBUÉ PAR I		2003		
te de dépôt attribué R l'inpi	it.			
os références p	our ce dossier			•
acultatif) ONEF	RA 305 (120797)			
	n dépôt par télécopie	☐ N° attribué pa	r l'INPI à la télécopie	
NATURE DE	The second secon	Cochez l'une des	4 cases suivantes	
200 Carrier of Carrier (1980)	\$1.75 parts 5.50 parts 16.7 57 parts 10.00 parts 10.00 parts 10.00 parts 10.00 parts 10.00 parts 10.00 parts 1	X		
Demande de l				
	certificat d'utilité	 		
Demande divi	sionnaire	📙	1 . 1 .	1
	Demande de brevet initiale	No	Date L	
da	ande de certificat d'utilité initiale	N°	Date	
	on d'une demande de			
transformatio	en Demande de brevet initiale	N°	Date	
	÷	. ;		
4 DÉCLARATION	ON DE PRIORITÉ	Pays ou organisat	on N°	
	E DU BÉNÉFICE DE	Date		•
	DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisat	N°	
	ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisat	ion	
DEMANDE	ANTERIEURETIONION	Date	N°	
	•	S'il y a d'	autres priorités, cochez la case et utilise	z l'imprimé «Suite»
E DEMANDE	JR (Cochez l'une des 2 cases	Z Personne	morale Personne phys	ique
		ONEBA (Office	e National d'Etudes et de Recherches	aérospatiales)
Nom ou dénomina	ation sociale	ONERA (Offic	e National d Liddes et de Neone, eve	
Prénoms				
Forme juridique		Etablissement public à caractère industriel et commercial		
N° SIREN		[7 ₁ 7 ₁ 5 ₁ 7 ₁ 2 ₁ 2 ₁ 8 ₁ 7 ₁ 9]		
Code APE-NAF		[7;3 _[1]Z]		
			a Division Leclerc	
Domicile ou	Rue		NATILIAN	
ou siège	Code postal et ville	191213121010	CHATILLON	
	Pays	FRANCE		<u> </u>
Nationalité		française	N° de télécopie (facultatif)	
N° de téléphone (facultatif)			in de telecopie (Jacanary)	
Adresse élec	ctronique (facultatif)		d'un demandeur, cochez la case et utili	sez l'imprimé «Suite»
		S'il y a plus	d'un demandeur, cochez la case et dens	



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



REMIS	E BES PIECES	IL 2003à l'INPI			
DATE	75 INPLE	'ARIS			
TIEN		0304104			
	NREGISTREMENT		DB 540 W / 210)50:	
- No.	NAL ATTRIBUÉ PAR	PERSONAL PROPERTY OF THE PROPE			
6	MANDATAIRI	(s'il y a heu)			
	Nom		ROUSSET		
	Prénom		Jean-Claude		
	Cabinet ou So	ciété	Cabinet NETTER		
	N °de pouvoir de lien contra	permanent et/ou ctuel			
	Rue		36 avenue Hoche		
1	Adresse	Code postal et ville	[7 5 0 0 8] PARIS		
1		Pays	France		
-	N° de télépho		01 58 36 44 22		
	N° de télécop		01 42 25 00 45		
		ronique (facultatif)		52.2	
7	INVENTEUR	(S)	Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques		
	Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		Oui Non: Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)		
8	RAPPORT DE	RECHERCHE	Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation	1	
	- 1 may 100 to 1 a 4 a 4 to 1 a 20 as a 1 a 20	Établissement immédiat ou établissement différé		_	
	Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt Oui Non	t 	
9	9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG		
10	SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		Cochez la case si la description contient une liste de séquences		
	Le support éle	ectronique de données est joint	ıt 🗀		
	La déclaration	n de conformité de la liste de ur support papier avec le ronique de données est jointe			
	Si vous avez	utilisé l'imprimé «Suite», nombre de pages jointes	1		
m	SIGNATURE OU DU MAN (Nom et qua Paris, lo Jean-C	DU DEMANDEUR	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPÎ		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faite à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

CERTIFICAT D'UTILITÉ N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

BREVET D'INVENTION



INDUSTRIELLE 26 bis, rue de Saint Péters	houra	REQUÊ	te en delivrance	
TERRO Davie Codey OR		_		BR/suite
Féléphone : 33 (1) 53 04 5	53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86	34	Page suite N° 1/1	
	Pásavá à l'INPI		age suite it it,	
REMISE OF AREA PO	NE 2003			
DATE 75 INPLP	ARIS			
TIER	0304104	\		•
N° D'ENREGISTREMENT				
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L	INPI	Cet imprimé est à rem	plir lisiblement à l'encre noire	DB 829 @ W / 0107
	our ce dossier (facultatif)	ONERA 305 (120797)		
		Pays ou organisation		
4 DÉCLARATION		Date N°		
OU REQUÊTE	DU BÉMÉFICE DE	Pays ou organisation		•
LA DATE DE	DÉPÔT D'UNE	Date N°		
D	ntérieure française	Pays ou organisation		
J. C.	,,	Date N°		and the second section of the second
I DENIAMORIA	(Cochez l'una des 2 cases	[보 Personne morale	Personne physique	e susta de Asida
The same of the same of the same of				
Nom ou dénominati	on sociale	SNECMA MOTEURS		
	UII SOCIAIE			•
Prénoms		in this analysis		2.
Forme juridiqu	ie	société anonyme		7
. N° SIREN		[4,1,4,8,1,5,2,1,7]		
Code APE-NAI	F Y			
Damieile	Rue	2 boulevard du Général Martial Valii	1	
Domicile ou				
siège	Code postal et ville	[7:5:0:1:5] PARIS		
31085	Pays	FRANCE		
Nationalité		française	<u> </u>	
N° de télépho	ne (facultatif)			
N° de télécop		,		
	ronique (facultatif)			Charles and Charles and Charles
	R (Cochez l'une des 2 cases	Personne morale	Personne physique	
Nom	5 Maria 5 - 11 May 2 Maria 2 M			
ou dénomina	tion sociale			<u> </u>
Prénoms				
Forme juridiq	ue			
N° SIREN				
Code APE-NA	vF			
00007.1.271	Ī		•	
Domicile	Rue			
Ou .	Code postal et ville			
siège	Pays	· ·		
Nationalité	1 ' ","			
	one (facultatif)			· ·
	pie (facultatif)			
SI	tronique (facultatif)	1		
<u> </u>			VISA DE LA PI	RÉFECTURE
	DU DEMANDEUR Jea	n-Claude ROUSSET	OU DE L'	
OU DU MA	INDATAIRE n°	onseit 92-1217 (B) (M)	Company of the Compan	
(Mom et qu	alité du signataire)	Jens	-109	with the same of t
8				

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faite à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI

ONERA305.FRD

<u>Procédé pour former sur un métal un revêtement protecteur</u> <u>contenant de l'aluminium et du zirconium</u>

L'invention concerne un procédé pour former sur la surface d'un substrat métallique un revêtement protecteur contenant de l'aluminium, dans lequel on met en contact ledit substrat et un précurseur non gazeux contenant de l'aluminium, à une température élevée, avec une atmosphère contenant un gaz actif qui réagit avec le précurseur pour former un composé d'aluminium gazeux, lequel se décompose au contact du substrat en y

déposant de l'aluminium métallique.

Un tel procédé, connu sous le nom d'aluminisation, ou cémentation activée, est décrit dans FR 1433497 A. Il est utilisé pour la réalisation par diffusion de revêtements en alliage de type Ni-Al servant de couche intermédiaire entre le substrat en superalliage à base de nickel des pièces chaudes de moteurs d'avions et la barrière de protection thermique de ce substrat, permettant d'améliorer aussi bien la tenue de la barrière sur le substrat que la capacité de ce dernier à conserver des caractéristiques d'usage en cas de dégradation de la barrière thermique.

25

30

٠5

10

Ce procédé connu se déroule en régime statique. Le substrat et un cément contenant de l'aluminium sont enfermés dans une boite semi-étanche, celle-ci limitant fortement les échanges gazeux avec l'atmosphère extérieure. Durant le traitement, température et pression sont maintenues constantes. Il s'instaure ainsi, durant le processus de dépôt, un régime quasi-stationnaire et des conditions de proche équilibre sont obtenues entre cément et phase gazeuse d'une part, phase gazeuse et substrat d'autre part.

35

Pour aluminiser un substrat à base de nickel on choisit un cément donneur à base de chrome, où l'activité de Al est plus grande que dans le nickel à concentration en aluminium égale.

Le revêtement obtenu est constitué essentiellement par la phase β -NiAl de structure cubique simple. Cette phase possède un large domaine de non stoechiométrie allant de NiAl⁽⁺⁾ (57 % en atomes) à NiAl⁽⁻⁾ (37 % en atomes). Cette phase est aluminoformeur et ne donne pas lieu à une diffusion prépondérante de Al ou de Ni.

Au cours de l'aluminisation il s'instaure un processus cyclique de dépôt d'aluminium se poursuivant continuellement jusqu'à ce que l'activité en aluminium de la surface du substrat devienne égale à celle imposée par le cément.

10

25

30

Le processus d'aluminisation d'un substrat se décompose en quatre étapes:

- 15 1. formation à partir du cément d'une phase gazeuse assurant le transport de l'aluminium,
 - transport de cette phase gazeuse vers le substrat à revêtir,
- réactions de dismutation et de réduction à la surface du substrat avec libération d'aluminium,
 - 4. diffusion solide de l'aluminium déposé dans le substrat tendant à diminuer son activité en surface.

La vitesse globale de ce processus à quatre étapes consécutives est gouvernée par la vitesse de l'étape la plus lente. Le procédé s'effectue en enceinte semi-étanche, où les échanges gazeux avec l'extérieur sont très limités. On peut admettre que les vitesses des réactions chimiques aux interfaces gazsolide sont très élevées par rapport à celles des mécanismes de diffusion. Ainsi la cinétique globale de ce processus est gouvernée par l'importance relative de la diffusion dans la phase gazeuse et de la diffusion solide dans le revêtement en cours d'élaboration.

En premier, pour que tout ce processus ait lieu il faut que l'atmosphère dans laquelle le dépôt se forme n'interagisse pas avec ses mécanismes de formation. C'est pourquoi le gaz de couverture sera soit neutre (argon) soit réducteur (hydrogène). De même, pour qu'un transport en phase gazeuse de l'aluminium ait lieu il faut que cet élément soit présent dans

3

l'atmosphère. Cette présence est assurée par une molécule appelée "activateur". Son action est simple: l'activateur corrode le cément donneur pour former un halogénure d'aluminium gazeux. L'agent corrosif (un acide halogéné) est renouvelé à chaque dismutation sur le substrat receveur.

Dès lors l'activateur choisi doit être gazeux à la température du revêtement et ne doit pas produire de polluants. C'est pour cette raison que les activateurs généralement utilisés sont le chlorure d'ammonium NH₄Cl, le fluorure d'ammonium NH₄F et le bifluorure d'ammonium NH₄F,HF. En présence d'hydrogène ou sous gaz neutre et à température élevée, ces molécules se décomposent selon

$$NH_4X \rightarrow NH_3 + HX$$

15 où X représente Cl ou F.

10

20

35

La température de vaporisation dépend de la nature du sel halogéné choisi. Par exemple, elle est de 340 °C pour le chlorure d'ammonium. Dans le procédé connu, l'activateur n'est utilisé que pour transporter en toute sécurité un acide halogéné dans le réacteur où le dépôt doit être effectué, c'est à dire la boîte semi-étanche. Le cation lié à cet halogène (ici l'ammonium) est par voie de conséquence inutile.

Par ailleurs, divers travaux ont montré l'effet favorable du zirconium sur l'adhérence d'une couche d'oxyde sur un substrat métallique, que cette couche soit formée par exposition à l'air à haute température ou par dépôt d'une barrière thermique. Cependant aucun procédé utilisable industriellement n'a été proposé pour introduire cet élément dans un revêtement protecteur contenant de l'aluminium.

Le but de l'invention est d'aménager à cet effet le procédé connu décrit plus haut.

L'invention vise notamment un procédé du genre défini en introduction, et prévoit que ladite atmosphère contient un composé gazeux d'un métal modificateur qui se décompose au

contact du substrat en y déposant ledit métal modificateur, simultanément au dépôt d'aluminium.

Des caractéristiques optionnelles de l'invention, complémentaires ou de substitution, sont énoncées ci-après:

- Ledit métal modificateur est choisi parmi le zirconium, le hafnium et l'yttrium.
- 10 Ledit gaz actif est constitué au moins en partie par ledit composé gazeux.
 - Ledit gaz actif est constitué exclusivement par ledit composé gazeux.

*

- Ledit gaz actif contient en outre au moins un composé d'ammonium.

15

30

- Ledit gaz actif et/ou ledit composé gazeux sont formés par
 vaporisation d'au moins une substance solide à température ambiante, mélangée audit précurseur.
- Le substrat contient au moins un élément qui se combine avec l'aluminium pour former dans le revêtement un composé intermétallique dans lequel l'aluminium est partiellement substitué par le métal modificateur.
 - Ledit élément du substrat est le nickel et ledit composé intermétallique est $\beta\text{-NiAl}$.
 - Le substrat est en superalliage à base de nickel.
 - Ledit gaz actif et/ou ledit composé gazeux contiennent au moins un halogène.
 - Ledit composé gazeux est au moins un composé choisi parmi ${\rm ZrCl_4}$, ${\rm ZrOCl_2}$ et $({\rm NH_4})_2{\rm ZrF_6}$.



- Ledit gaz actif contient au moins un composé choisi parmi $\mathrm{NH_4Cl}$, $\mathrm{NH_4F}$ et $\mathrm{NH_4F}$, HF .
- Ledit précurseur est un alliage d'aluminium et de chrome.

5

- Le substrat et le précurseur sont distants l'un de l'autre.
- Le substrat est disposé au-dessus du précurseur.
- 10 Le substrat est disposé au contact du précurseur.
 - Le substrat et le précurseur sont disposés dans une enceinte n'autorisant que des échanges limités avec l'extérieur.
- 15 Ladite atmosphère est formée, outre le gaz actif et le composé gazeux, d'un gaz inerte ou réducteur et de préférence d'hydrogène.
- L'élément modificateur est contenu dans ledit revêtement 20 protecteur en une concentration massique inférieure à 0,5 %.
 - Ladite concentration massique est comprise entre 500 et 1000 ppm et de préférence d'environ 800 ppm.
- 25 Ladite température élevée est comprise entre 950 et 1200 °C et de préférence d'environ 1080 °C.

Les caractéristiques et avantages de l'invention seront exposés plus en détail dans la description ci-après, en se référant aux dessins annexés.

Les figures 1 et 2 sont des graphiques montrant la répartition du zirconium dans des revêtements obtenus par le procédé selon l'invention.

35

Dans le procédé selon l'invention, l'halogénure d'ammonium du procédé connu est remplacé au moins en partie par un composé de l'élément que l'on souhaite voir présent dans le dépôt à l'état de traces, notamment un composé de zirconium.

Parmi les sels de zirconium susceptibles de jouer le rôle d'un activateur, on trouve le chlorure de zirconium ${\rm ZrCl_4}$, l'oxychlorure de zirconium ${\rm ZrOCl_2}$ et le fluozirconate d'ammonium $({\rm NH_4})_2{\rm ZrF_6}$, cette liste n'étant pas limitative. Tous ces sels présentent l'avantage d'être gazeux au-delà de 250 °C. Pour des raisons de commodité et de sécurité il est avantageux d'utiliser l'oxychlorure de zirconium.

Le principe du dépôt reste identique à celui du procédé antérieur: une boite semi-étanche en alliage nickel-chrome ou en acier réfractaire de type NCD 16 contient du cément sous forme de granulés grossiers, d'un diamètre de grains compris entre un millimètre et quelque centimètres. Les pièces à revêtir sont suspendues à quelque centimètres au-dessus du cément de façon à être plongées dans le flux d'halogénure d'aluminium gazeux. Selon l'invention, l'halogénure d'ammonium est remplacé en tout ou en partie par de l'oxychlorure de zirconium. Ce dernier en s'évaporant conduit à la formation d'une vapeur riche en chlorure de zirconium qui se dismute à la surface du substrat en superalliage à base de nickel pour former du zirconium à l'état métallique d'une part et un acide halogéné disponible pour former dans le cément donneur un halogénure d'aluminium d'autre part. Le zirconium déposé la surface du substrat diffuse ensuite dans le revêtement de eta-NiAl en cours de formation pour donner, in fine, un intermétallique enrichi entre 500 et 1000 ppm de zirconium.

En variante, les pièces à revêtir sont en contact avec le cément, comme par exemple selon la technique de cémentation en caisse où les pièces sont immergées dans le cément en poudre.

Ce principe général est illustré par les exemples qui suivent, sans que ces derniers aient un caractère limitatif quelconque.

Exemple comparatif

5

10

15

20

25

30

35

Cet exemple illustre l'art antérieur. Dans une boite semiétanche on dispose un cément donneur d'aluminium constitué d'un alliage chrome-aluminium dans les proportions massiques

O. C.

de 70 % de chrome pour 30 % d'aluminium. On y ajoute 10 g de bifluorure d'ammonium NH $_4$ F,HF en tant qu'activateur pour 1000 g de cément (1 % en masse). Les pièces à traiter sont placées au-dessus du mélange cément + activateur. Après un traitement de 6 heures à 1080 °C sous hydrogène on obtient la formation d'un revêtement de β -NiAl stoechiométrique. Ce revêtement a une épaisseur d'environ 50 μ m. Sa microstructure est classique: une couche monophasée de β -NiAl, d'une épaisseur d'environ de 40 μ m, surmonte une zone d'interdiffusion d'environ 10 μ m d'épaisseur où sont présentes des phases TCP riches en éléments insolubles ou peu solubles dans la phase β . L'apparition de ces phases est due à la diffusion du nickel vers le revêtement.

15 Exemple 1

¹ 5

10

20

25

30

On procède comme dans l'exemple comparatif en remplaçant le bifluorure d'ammonium par une quantité équivalente (mole pour mole) d'oxychlorure de zirconium. À l'issue du traitement on obtient un revêtement d'une épaisseur d'environ 50 μ m. Cependant, à la différence du cas précédent, ce dépôt présente trois zones distinctes. En contact avec le substrat, la zone d'interdiffusion, d'une épaisseur de 10 μ m environ, est classique. Cette zone est surmontée par un revêtement de β -NiAl monophasé d'une épaisseur d'environ 40 μ m. Enfin, une zone supplémentaire d'une épaisseur d'environ 10 μ m est constituée d'une matrice en β -NiAl contenant des précipités de chrome-zirconium. Une analyse du profil de concentration sur une épaisseur de 20 µm par spectroscopie de masse (Glow Discharge Mass Spectroscopy, GDMS) montre que le zirconium est concentré dans les premiers micromètres et que sa concentration dans le reste du revêtement est d'environ 200 parties par million (ppm) en masse.

Exemple 2

On procède comme dans l'exemple 1 en remplaçant le cément donneur d'aluminium-chrome à 30 % d'aluminium par un cément à base de chrome à 20 % d'aluminium. Cette diminution de l'activité en aluminium a pour but de favoriser une meilleure répartition du zirconium dans l'ensemble du revêtement. Comme

dans l'exemple précédent, la température de traitement est de 1080 °C et l'atmosphère de travail de l'hydrogène. Cependant, pour compenser la faible activité de l'aluminium, la durée du traitement est allongée à 16 heures. À l'issue de ce traitement, on obtient un revêtement d'une épaisseur d'environ 50 μm . Ce revêtement est constitué de deux parties: une zone d'interdiffusion de 10 μm environ contenant les phases TCP classiques et un revêtement proprement dit d'une épaisseur d'environ 40 μm et constitué d'une matrice de $\beta\text{-NiAl}$ stoechiométrique contenant du zirconium en solution solide et exempt de précipité. Une analyse GDMS donne le profil de concentration en zirconium tel que montré sur la figure 1 (concentration massique en ppm en fonction de la profondeur en μm).

15

10

5

Cette analyse confirme l'hypothèse selon laquelle le zirconium se dépose en premier à la surface du substrat à revêtir puis diffuse à l'état solide au travers de la couche d'aluminiure de nickel en cours de formation.

į.

20

25

30

35

Exemple 3

On se propose, dans cet exemple, de montrer qu'il est possible de piloter la concentration en zirconium obtenue dans le revêtement par une simple dilution de la quantité d'activateur à base de Zr. Pour ce faire on procède comme dans l'exemple comparatif en remplaçant une partie seulement du bifluorure d'ammonium (l'activateur) par de l'oxychlorure de zirconium. Dans le cas présent, le rapport ZrOCl2/NH4F, HF en moles est de 1/9. Ici aussi on obtient un revêtement d'aluminiure de nickel d'une épaisseur d'environ 50 μm avec une couche d'interdiffusion d'environ 10 μ m et une couche de β -NiAl stoechiométrique de 40 μ m d'épaisseur. Une analyse GDMS pratiquée sur une profondeur de 20 μ m montre que la teneur moyenne en zirconium est réduite par rapport à l'exemple précédent. De plus, le cément donneur étant différent (activité plus élevée), le profil de concentration obtenu est lui aussi différent, comme le montre la figure 2.

Revendications

- 1. Procédé pour former sur la surface d'un substrat métallique un revêtement protecteur contenant de l'aluminium, dans lequel on met en contact ledit substrat et un précurseur non gazeux contenant de l'aluminium, à une température élevée, avec une atmosphère contenant un gaz actif qui réagit avec le précurseur pour former un composé d'aluminium gazeux, lequel se décompose au contact du substrat en y déposant de l'aluminium métallique, caractérisé en ce que ladite atmosphère contient un composé gazeux d'un métal modificateur qui se décompose au contact du substrat en y déposant ledit métal modificateur, simultanément au dépôt d'aluminium.
- 15 2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel ledit métal modificateur est choisi parmi le zirconium, le hafnium et l'yttrium.
- Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, dans
 lequel ledit gaz actif est constitué au moins en partie par ledit composé gazeux.
 - 4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel ledit gaz actif est constitué exclusivement par ledit composé gazeux.
 - 5. Procédé selon la revendication 3, dans lequel ledit gaz actif contient en outre au moins un composé d'ammonium.
- 6. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ledit gaz actif et/ou ledit composé gazeux sont formés par vaporisation d'au moins une substance solide à température ambiante, mélangée audit précurseur.
- 7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le substrat contient au moins un élément qui se combine avec l'aluminium pour former dans le revêtement un composé intermétallique dans lequel l'aluminium est partiellement substitué par le métal modificateur.

- 8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel ledit élément du substrat est le nickel et ledit composé intermétallique est β -NiAl.
- 9. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le substrat est en superalliage à base de nickel.
 - 10. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ledit gaz actif et/ou ledit composé gazeux contiennent au moins un halogène.

10

- 11. Procédé selon la revendication 10, dans lequel ledit composé gazeux est au moins un composé choisi parmi $ZrCl_4$, $ZrOCl_2$ et $(NH_4)_2ZrF_6$.
- 12. Procédé selon l'une des revendications 10 et 11, dans lequel ledit gaz actif contient au moins un composé choisi parmi NH₄Cl, NH₄F et NH₄F, HF.
- 20 13. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ledit précurseur est un alliage d'aluminium et de chrome.
- 14. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans 25 lequel le substrat et le précurseur sont distants l'un de l'autre.
 - 15. Procédé selon la revendication 14, dans lequel le substrat est disposé au-dessus du précurseur.
 - 16. Procédé selon l'une des revendications 1 à 13, dans lequel le substrat et le précurseur sont en contact.
- 17. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le substrat et le précurseur sont disposés dans une enceinte n'autorisant que des échanges limités avec l'extérieur.

18. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ladite atmosphère est formée, outre le gaz actif et le composé gazeux, d'un gaz inerte ou réducteur et de préférence d'hydrogène.

5

19. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'élément modificateur est contenu dans ledit revêtement protecteur en une concentration massique inférieure à 0,5 %.

- 20. Procédé selon la revendication 19, dans lequel ladite concentration massique est comprise entre 500 et 1000 ppm et de préférence d'environ 800 ppm.
- 15 21. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ladite température élevée est comprise entre 950 et 1200 °C et de préférence d'environ 1080 °C.

Fig. 1

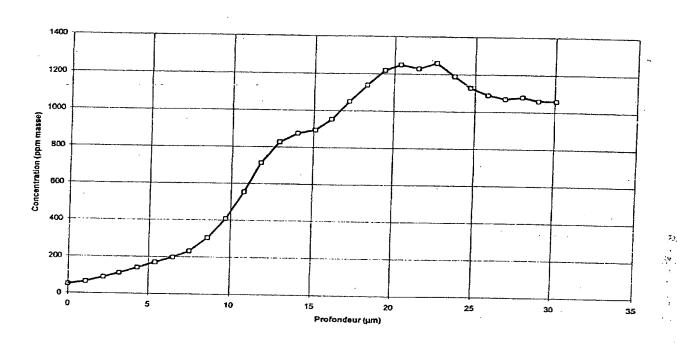
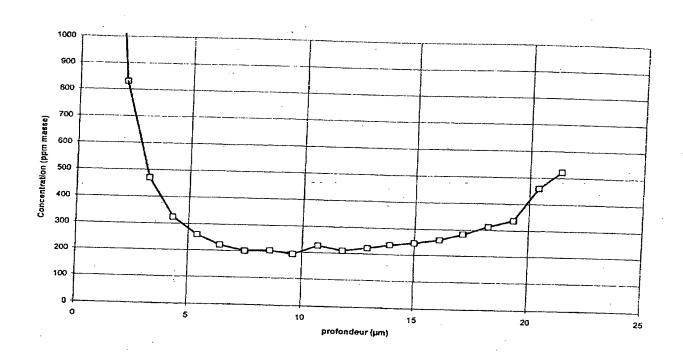
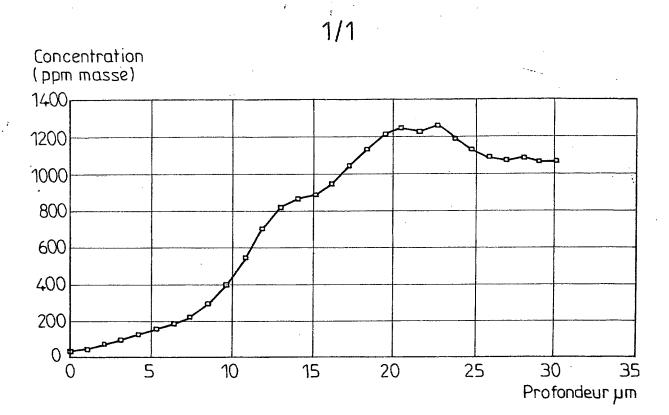
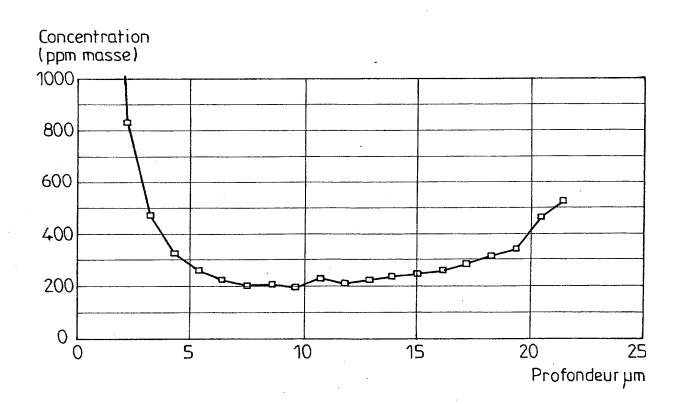


Fig. 2



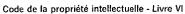






BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ





DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

75800 Paris Cedex 08 Féléphone : 01 53 04 5	3 04 Télécopie : 01 42 93 59 30		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	DB 113 W /2608	
Vos références (facultatif)	pour ce dossier	ONERA 30	5 (120797)		
	REMENT NATIONAL			*	
TITRE DE L'INVI	ENTION (200 caractères ou e	spaces maximum	n)		
		•	eur contenant de l'aluminium et du zirconium		
		·			
LE(S) DEMAND	EUR(S):				
ONERA (Office	National d'Etudes et de R	echerches Aéi	ospatiales) et SNECMA MOTEURS	·	
			z en haut à droite «Page №° 1/1» S'il y a plu page en indiquant le nombre total de pages).	s de trois inventeurs,	
Nom		BACOS			
Prénoms		Marie-Pier	re		
Adresse	Rue	19bis rue Pasteur		(∞)	
	Code postal et ville	92160	ANTONY	1215	
Société d'apparte	nance (facultatif)				
Nom	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JOSSO			
Prénoms	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pierre			
Adresse	Rue	61 L'Aigle 44 rue d'Erévan			
	Code postal et ville	92130	ISSY LES MOULINEAUX		
Société d'apparte	nance (facultatif)				
Nom		NAVÉOS	,		
Prénoms		Serge	Serge		
Adresse	Rue	29 rue de C	hateaubriand		
	Code postal et ville	92290	CHATENAY-MALABRY		
Société d'apparte	nance (facultatif)				
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Le 2 avril 2003 Jean-Claude ROUSSET		1	Jun.		
n° conseil 92-1217 (B) (M)					

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

THIS PAGE BLANK (USPTO)